

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2024]23 号

关于召开《LED 外延芯片用砷化镓衬底》等 12 项半导体材料标准 工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2024 年标委会工作安排，现定于 2024 年 10 月 14 日~16 日在云南省昆明市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《LED 外延芯片用砷化镓衬底》等 12 项半导体材料标准进行审定和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 10 月 9 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 10 月 12 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2024 年 10 月 14 日全天。

2、报到地点：昆明云安会都酒店（昆明西山区石安公路马街路口，电话：0871-68175666）。

3、乘车路线：①昆明长水国际机场：步行至长水机场地铁站乘坐地铁6号线至东部汽车站，换乘地铁3号线至大渔路站，步行900米到达酒店；乘出租车到酒店约45公里，约100元；②昆明站：步行至昆明火车站地铁站乘坐地铁1号线至东风广场站，换乘3号线至大渔路站，步行900米到达酒店；乘出租车到酒店约11公里，约20元；③昆明南站：步行至昆明南火车站地铁站乘坐地铁4号线至大树营站，换乘3号线至大渔路站，步行900米到达酒店；乘出租车到酒店约37公里，约90元。

三、会务及联系人

本次会议由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于2024年10月9日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费850元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为保障会议用房安排和会议资料的准备，10月9日之后及现场缴费收取1200元/人。汇款请注明：10月昆明半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

二〇二四年九月十三日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

会议审定和讨论的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	国标委发[2023]58 号 20231115-T-469	LED 外延芯片用砷化镓衬底	南京集溢半导体科技有限公司	审定
2		国标委发[2024]28 号 20241934-T-469	太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片	南京集溢半导体科技有限公司	讨论
3		工信厅科[2024]18 号 2024-0218T-YS	高纯砷	峨眉山嘉美高纯材料有限公司	讨论
4		中色协科字[2023]95 号 2023-035-T/CNIA	质量分级及“领跑者”评价要求 高纯二氧化锗	昆明冶金研究院有限公司	审定
5		中色协科字[2023]95 号 2023-037-T/CNIA	绿色设计产品评价技术规范 高纯二氧化锗	云南驰宏国际锗业有限公司	审定
6		中色协科字[2023]95 号 2023-038-T/CNIA	绿色设计产品评价技术规范 锗单晶和锗单晶片	云南驰宏国际锗业有限公司	审定
7	第二组	工信厅科[2023]18 号 2023-0082T-YS	半导体材料掺杂用扩散膜	安徽安芯电子科技股份有限公司	审定
8		工信厅科[2023]18 号 2023-0001T-YS	集成电路用四甲基硅烷	洛阳中硅高科技有限公司	审定
9		中色协科字[2023]95 号 2023-041-T/CNIA	蓝宝石晶体生长隔热用氧化锆纤维屏	南京理工宇龙新材料科技股份有限公司	审定
10		国标委发[2024]16 号 20240142-T-469	蓝宝石单晶衬底抛光片	天通银厦新材料有限公司	讨论
11		国标委发[2024]16 号 20240137-T-469	蓝宝石图形化衬底表面图形几何参数的测定方法	广东中图半导体科技股份有限公司	讨论
12		国标委发[2024]16 号 20240136-T-469	金刚石单晶抛光片位错密度的测试方法	中国科学院半导体研究所	讨论